

〈招待講演〉

高圧せん断ひずみ法による  
新奇半導体材料の開発

Development of novel semiconductor materials  
utilizing shear strain under high pressure

講師：生駒 嘉史 先生

九州大学大学院工学研究院  
材料工学部門

日時 2021年11月2日(火)  
14:30~16:00

会場 オンライン  
(<https://sagauniv.webex.com>)

※参加ご希望の方は10月28日(木)までにお申し込み下さい



【お申し込み・お問い合わせ】

佐賀大学

シンクロトロン光応用研究センター事務室

TEL: 0952-28-8854 E-mail: [slcjimu@ml.cc.saga-u.ac.jp](mailto:slcjimu@ml.cc.saga-u.ac.jp)

HP: <http://www.sl.c.saga-u.ac.jp/>

参加費  
無料  
学生の方も  
歓迎します

共催：シンクロトロン光に関する大学間連携会議